PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11) Publication number: **07176871** A

(43) Date of publication of application: 14.07.95

(51) Int CI

H05K 3/46 H05K 3/40

(21) Application number: 05321675

(22) Date of filing: 21 . 12 . 93

(71) Applicant

MATSUSHITA ELECTRIC IND CO

LTD

(72) Inventor.

MITAMURA SADAO NAKAMURA SHINJI TAKENAKA TOSHIAKI KISHIMOTO KUNIO **NISHII TOSHIHIRO OTANI HIROYUKI** SATO SHOJI

HIGASHIDA TAKAAKI

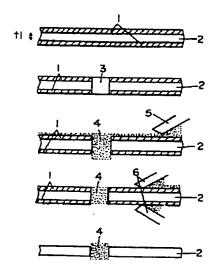
(54) MANUFACTURE OF RESIN MULTILAYERED **BOARD**

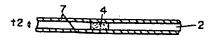
(57) Abstract:

PURPOSE: To quantify the fill of paste by printing when a viahole is filled with conductive paste, and form a resin multilayer board of uniform quality.

CONSTITUTION: A resin board 2 is clamped by release films 2, and a through hole 3 is formed. After conductive paste 4 is buried in the through hole 3 with a first squeegee 5 having rubber elasticity so as to overflow, the paste 4 in unnecessary parts is scratched off with a second hard squeegee 6 so as to form the same level face as the film 1 surface. Thereby the paste amount of the through hole 3 part is quantified.

COPYRIGHT: (C)1995, JPO





(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 公開特許公報 (A)

FΙ

(11)特許出顧公開番号

特開平7-176871

(43)公開日 平成7年(1995)7月14日

(51)	Int.	Cl.	
(21)	шь	CI.	

H05K 3/46

識別記号 庁内整理番号

T 6921-4E

N 6921-4E

3/40

K 7511-4E

技術表示箇所

審査請求 未請求 請求項の数4 OL (全 5 頁)

順番号
順番号

特顧平5-321675

(22)出顧日

平成5年(1993)12月21日

(71)出顧人 000005821

松下電器產業株式会社

大阪府門真市大字門真1006番地

(72) 発明者 三田村 貞雄

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 中村 眞治

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(72)発明者 竹中 敏昭

大阪府門真市大字門真1006番地 松下電器

産業株式会社内

(74)代理人 弁理士 小鍜治 明 (外2名)

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 樹脂多層基板の製造方法

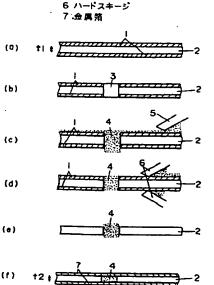
(57)【要約】

【目的】 Viaホールへの導電ベーストの充填において、印刷によるベースト充填量を定量化させ、均質な樹脂多層基板を形成する。

【構成】 離型性フィルム1で狭持され、スルーホール 3が設けられた樹脂基板2に、導電ペースト4を第一の ゴム弾性を有するスキージ5で、スルーホール3表面に 溢れる形で埋め込んだ後、第二のハードなスキージ6で 不要部のペースト4を、フィルム1面と面一に掻き取り、スルーホール3部のペースト量を定量化させる。

1 離型性フィルム 2 アラミドーエボキシシート(多孔質基材) 3 質達孔

4 導電性ペースト 5 ソフトスキージ



【特許請求の範囲】

【請求項1】離型性フィルムを具備した被圧縮性を有する多孔質基材に貫通孔を設け、前記貫通孔に導電性ペーストを充填する工程と、前記貫通孔に充填された前記導電性ペーストの充填量を均一にする工程とを有する樹脂多層基板の製造方法。

【請求項2】離型性フィルムを具備した被圧縮性を有する多孔質基材に貫通孔を設け、前記貫通孔に導電性ペーストを責通孔の体積以上の導電ペーストを充填し、充填後に貫通孔より溢れた導電性ペーストを前記離型性フィ 10ルム面と面一に掻き取り、充填量を均一にする請求項1記載の樹脂多層基板の製造方法。

【請求項3】離型性フィルムを具備した被圧縮性を有する多孔質基材に貫通孔を設け、前記貫通孔に導電性ペーストを充填する工程と、導電性ペーストの充填量を均一にする各工程において、個々のスキージ硬度が異なり、充填量を均一にする工程のスキージが、硬度大なるスキージを備えた印刷機で充填する請求項1記載の樹脂多層基板の製造方法。

【請求項4】ゴム弾性を有するスキージを用いて導電性 20ペーストを充填する工程が実施され、金属、およびセラミックからなるスキージを用いて導電性ペーストの充填量を均一にする工程が実施される請求項1記載の樹脂多層基板の製造方法。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【産業上の利用分野】本発明は、両面に金属箔を有する 樹脂多層回路基板の製造方法に関する。

[0002]

【従来の技術】近年、電子機器の小型化、高密度化に伴 30 ととがある。い、産業用にとどまらず民生用の分野においても多層回 路基板が強く要望されるようになってきた。このような の上に銅箔 2 を層回路基板では、複数層の回路パターンの間をインナ ビアホール接続する接続方法および信頼度の高い構造が うに、銅箔 3 が要である。 間に運営性へ

【0003】以下従来の2層回路基板の製造方法について説明する。図2(a)~(f)は従来の2層回路基板の製造方法を示す工程断面図である。まず、図2(a)に示すように、両面に離型性フィルム21を備えた多孔質基材22を用いる。この多孔質基材としては、例えば40芳香族ポリアミド繊維に熱硬化性エポキシ樹脂を含浸させ、内部に空孔を有する複合材からなる基材(以下アラミドーエポキシシートと称する)が用いられる。

【0004】次に図2(b)に示すようにアラミドーエポキシシート22に例えばレーザーなどにより回路に合致した貫通孔23を形成する。

【0005】次に図2(c)に示すように貫通孔23に 導電性ペースト24を印刷により充填する。この導電性 ペースト24は離型性フィルム21を印刷マスクとして 印刷することにより充填される。 【0006】次に図2(d)に示すように、アラミドーエポキシシート22の離型性フィルム21を剥離すると貫通孔23の内部に導電性ペースト24が充填されている。

【0007】次に図2(e)に示すように、アラミドーエポキシシート22の両面に銅箔27を張り付けた後、アラミドーエポキシシート22と銅箔27とを加熱加圧により本接着するとともに、導電性ペースト24を硬化させる。

0 【0008】次に図2(f)に示すように、銅箔27を 選択的にエッチングして第1の回路パターン27aおよび第2の回路パターン27bを形成する。

【0009】このようにして、第1の回路バターン27 aと第2の回路バターン27bとは貫通孔23に充填された導電性ペースト24によってインナビアホール接続され、2層配線回路基板28が得られる。

[0010]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら上記の従来の構成では、次のような課題を有していた。

【0011】第1に、従来の構成においては、貫通孔に 導電性ペーストを充填する印刷工程において、図2

(c) に示すように貫通孔に充填される導電性ペーストが充分に充填されず、かつ充填量にもばらつきが生じ、そのために加熱加圧後の導電性ペーストの密度にもばらつきが生じ、導電性ペーストと金属箔間の抵抗値にもばらつきが生じていた。

【0012】第2に、従来の構成においては、図2

【0013】この状態でアラミドーエポキシシート22の上に銀箔27を張り付けると、垂れ下がった導電性ペーストt24の逃げ場がなくなり、図3(a)に示すように、銅箔37とアラミドーエポキシシート32との隙間に導電性ペースト34が入り込むことがある。

【0014】このようなアラミドーエポキシシート32の銅箔37をエッチングして回路パターン37bを形成すると、図3(b)に示すように、第2の銅箔37bと 絶縁基板32との間に入り込んでいた導電性ペースト34によって短絡路34bが形成され、近接する回路パターン間の短絡不良の原因となる。

【0015】以上のような課題を有しているために、従来の回路形成用基板では単位面積当たりに形成できるインナビアホール接続の個数および回路パターン密度に限界があり、今後ますます需要が増大する高密度実装用多層基板を実現することが困難である。

【0016】本発明は上記従来の課題を解決するもので、インナビアホール接続時の導電性ベーストおよび導電性ベーストと金属箔間の接続抵抗を下げ、かつ近接したインナビアホール間の短格不良をなくした高性能、高

3

信頼性および高品質の回路基板を実現するための回路形成用基板の製造方法、および製造装置を提供することを 目的とする。

[0017]

[0018]

【作用】このようにゴム弾性を有する第一のスキージで、貫通孔に導電ベーストをフィルム上に残す形で印刷充填した後に、第二のハードスキージで、残った導電性ベーストを離型性フィルム面と面一になるように再充填することにより、貫通孔内の導電性ベースト量が増加すると共に貫通孔のベースト量が定量化される。

【0019】導電性ペーストの充填量が定量化され必要 20 量以上のはみ出しをなくすことにより、絶縁基板とその 両面に張り付けられた金属箔との間に余分な導電性ペーストの侵入がなくなり、近接する回路パターン間の短絡 不良の発生を防止でき、ファインパターンの形成と、導電ペーストが従来工法以上に緻密化されるため、低抵抗接続が可能となる。

[0020]

【実施例】以下本発明の一実施例における回路形成用基板の製造方法について、図面を参照しながら説明する。 【0021】図1(a)~(f)は本発明の第1の実施 30例における回路形成用基板の製造工程を示す工程断面図である。

【0022】まず図1(a)に示すように、両面にポリエステルなどの離型性フィルム1を備えた厚さt1のアラミドーエポキシシート2を準備する。

【0023】次に図1(b)に示すように、アラミドーエボキシシート2の所定の箇所にレーザ加工法などを利用して貫通孔3を形成する。

【0024】次に図1(c)に示すように、貫通孔3に 導電性ペースト4を充填する。 導電性ペースト4を充填 40 する方法としては、貫通孔3を有するアラミドーエポキシシート2を印刷機(図示せず)のテーブル上に設置し、直接導電性ペースト4を離型性フィルム1上の一部に載せ、ゴム弾性のある例えば硬度約60度のスキージ5で導電ペーストを貫通孔より溢れる形で印刷する。

【0025】この時、上面の離型性フィルム1は印刷マスクの役割と、アラミドーエポキシシート2の表面の汚染防止の役割を果たしている。

【0026】との段階ですでに導電性ペースト4のパインダの一部はアラミドーエポキシシート2側へ浸透し、

導電性ペースト4の内部ではバインダに対する導電物質の構成比が漸次増大して行く。

【0027】次に図1(d)に示すように、離型性フィルムの両面から例えば金属のスキージ6で離型性フィルムの上部に残ったペーストと、下部にはみでたペーストを離型性フィルム面と面一になるように掻き取り、貫通孔への充填量を均一にする。

【0028】更に図1(e)に示すようにアラミドーエポキシシート2の両面から離型性フィルム1を剥離する。

【0029】次に図1(f)に示すように、アラミドーエポキシシート2の両面に銅箔などの金属箔5を張り付ける。この状態で加熱加圧することにより、図1(f)に示すように、アラミドーエポキシシート2が圧縮されるとともにアラミドーエポキシシート2と金属箔5とが接着される。

【0030】この工程において、導電性ペーストも圧縮されるが、そのときに導電物質間からバインダ成分が押し出され、導電物質同士および導電物質と金属箔間の結合が強固になり、導電性ペースト中の導電物質が緻密化されるとともに、アラミドーエポキシシート2の厚さはt2に圧縮され、アラミドーエポキシシート2の一構成成分であるエポキシ樹脂および導電性ペースト4が硬化する。

【0031】本実施例をさらに詳しく説明すると、アラミドーエポキシシート2として厚さt1が150~220μm、空孔率が10~60%のアラミドーエポキシシートを用いた場合、図1(f)に示す加熱加圧による圧縮工程の後の厚さ、すなわちt2は60~200μm、空孔率は0~5%となり、空孔の形状も小さくなっている。

【0032】以上説明した実施例において使用する導電性ペースト4に含有される導電物質としては、銀、金、銀パラジウム、銅およびこれらの合金の一種以上のもが使用できる。

【0033】また導電物質の形状は球状であることが望ましい。すなわち、導電物質として球状の金属粒子を使用することにより、導電性ペースト4に圧力が加えられた時、金属粒子同士の接触部からパインダを押し出し易く、また金属粒子同士の接触部が塑性変形しやすいために金属粒子同士および金属粒子と金属箔とが強固に結合し、インナビアホール接続時の抵抗を極めて低くすることができる。

【0034】更に、導電ペーストを掻き取り充填量を均一にするスキージ6は、金属、セラミックなど硬質材料の方が望ましい。

[0035]

【発明の効果】以上のように本発明は、離型性フィルムを備えた被圧縮性を有する不織布と熱硬化性樹脂の複合 50 材からなる多孔質基材に貫通孔を設け、その貫通孔に導

6

電性ペーストを充填する工程において、貫通孔に導電性ペーストを定量的に充填できるため、金属粒子がより級 密化され抵抗値のばらつきを押さえ、更に低抵抗で高信頼性のインナビアホール接続を有する回路形成用基板の 製造方法を実現できる。

5

【0036】したがって本発明によれば、高密度回路基板、低回路インピーダンスが要求される低雑音用回路基板または高周波用回路基板などを容易に実現できる。

【図面の簡単な説明】

【図1】本発明の一実施例における回路形成用基板の製 10 造方法を示す工程断面図

【図2】従来の2層回路基板の製造方法を示す工程断面*

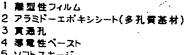
*図

【図3】従来の2層回路基板の製造方法における課題を 示す断面図

【符号の説明】

- 1 離型性フィルム
- 2 アラミド-エポキシシート (多孔質基材)
- 3 貫通孔
- 4 導電性ペースト
- 5 ソフトスキージ
- 6 ハードスキージ
- 7 金属箔

[図1]



- 5 ソフトスキージ 6 ハードスキージ 7 金属箔
- (0) †| †
- (b) 3
- (c) 4 5 2
- (d)
- (e) _______2
- (f) t2: 2 2

【図2】

